

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	จ
สารบัญตาราง	ณ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 หลักการที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคอนกรีตอัด	3
2.1.1 คุณสมบัติทั่วไปของคอนกรีตอัด	3
2.1.2 โครงสร้างผลึกของคอนกรีตอัด	4
2.2 อันตรกิริยาระหว่างแสงกับวัสดุ	6
2.2.1 ทฤษฎีสนามผลึก	9
2.2.2 โครเมียมและการเกิดสีในทับทิม	12
2.3 ทิศนศาสตร์ของผลึก	14
2.4 อันตรกิริยาระหว่างไอออนกับวัสดุ	17
2.4.1 การสูญเสียพลังงานของไอออน	18
2.4.2 Stopping cross section	19
2.4.3 ความไวระเบียนของผลึกเนื่องจากการฝังไอออน	21
2.5 การแพร่ของอะตอมในของแข็ง	24
2.5.1 การแพร่ในสถานะคงตัว	26
2.5.2 การแพร่ในสถานะไม่คงตัว	26
2.5.3 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อสัมประสิทธิ์การแพร่	28
2.6 การศึกษาเกี่ยวกับการฝังไอออนบนอะลูมิเนียมออกไซด์	29
บทที่ 3 การทดลอง	34
3.1 วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	34
3.1.1 ชิ้นงานที่ใช้ในการทดลอง	34
3.1.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	34

3.2	การถ่ายภาพอะลูมิเนียมออกไซด์	34
3.3	การวัดดัชนีหักเห	35
3.4	การวัดการดูดกลืนแสง	36
3.5	การฝังไอออนของอาร์กอนและออกซิเจน	39
3.6	การคำนวณโดสจากการฝังไอออน	41
3.7	การใช้โปรแกรม Profile คำนวณการฝังไอออนของอาร์กอนและออกซิเจน ในอะลูมิเนียมออกไซด์	43
บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล		50
4.1	ลักษณะอะลูมิเนียมออกไซด์หลังฝังอาร์กอนไอออน	50
4.1.1	การฝังอาร์กอนไอออนในแท็บทิมสังเคราะห์	50
4.1.2	การฝังอาร์กอนไอออนในเซฟไฟร์สังเคราะห์	50
4.2	ลักษณะอะลูมิเนียมออกไซด์หลังฝังออกซิเจนไอออน	50
4.2.1	การฝังออกซิเจนไอออนในแท็บทิมสังเคราะห์	50
4.2.2	การฝังออกซิเจนไอออนในเซฟไฟร์สังเคราะห์	50
4.3	การวัดดัชนีหักเห	51
4.4	การวัดการดูดกลืนแสงก่อนและหลังฝังไอออน	53
4.4.1	การวัดการดูดกลืนแสงก่อนและหลังฝังไอออนในแท็บทิมสังเคราะห์	53
4.4.2	การวัดการดูดกลืนแสงก่อนและหลังฝังไอออนในเซฟไฟร์สังเคราะห์	55
4.5	การดูดกลืนแสงหลังฝังไอออนและหลังอบในแท็บทิมและเซฟไฟร์สังเคราะห์	58
4.5.1	การดูดกลืนแสงหลังฝังอาร์กอนไอออนและหลังอบ ในแท็บทิมสังเคราะห์	58
4.5.2	การดูดกลืนแสงหลังฝังอาร์กอนไอออนและหลังอบ ในเซฟไฟร์สังเคราะห์	62
4.5.3	การดูดกลืนแสงหลังฝังออกซิเจนไอออนและหลังอบ ในแท็บทิมสังเคราะห์	66
4.5.4	การดูดกลืนแสงหลังฝังออกซิเจนไอออนและหลังอบ ในเซฟไฟร์สังเคราะห์	70
4.6	ผลการวิเคราะห์โดสด้วย Rutherford Backscattering Spectrometry (RBS)	74
4.7	การตรวจสอบพื้นผิวตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	76

4.7.1	ลักษณะพื้นผิวจากการฝังอาร์กอนไอออนในทับทิม และไพลีนสังเคราะห์	75
4.7.2	ลักษณะพื้นผิวจากการฝังออกซิเจนไอออนในทับทิม และแซฟไฟร์สังเคราะห์	76
4.8	อภิปรายผลการทดลอง	79
บทที่ 5	สรุปผล	81
5.1	สรุปผลการทดลอง	80
เอกสารอ้างอิง		82
ภาคผนวก ก		85
ประวัติผู้เขียน		86

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved

สารบัญตาราง

ตาราง	หน้า
2.1 คลื่นแสงที่ถูกสารดูดกลืนและสีที่มองเห็น	8
2.2 ค่า Q และ D_0 ของอะตอมที่เป็นตัวถูกละลายในของแข็งบางชนิด	28
2.3 คำนิยามในช่องว่างของออกซิเจนในอะลูมิเนียมออกไซด์และตำแหน่งการดูดกลืนแสงของคำนิยาม	30
3.1 โดสของ Ar^+ และ O^+ ที่ฝังในทับทิมและแซฟไฟร์สังเคราะห์	40
4.1 ดัชนีหักเหของทับทิมและแซฟไฟร์สังเคราะห์ ก่อนฝังไอออน หลังฝังอาร์กอน และหลังอบที่ 800 °ซ เวลา 1 ชั่วโมง	52
4.2 ดัชนีหักเหของทับทิมและแซฟไฟร์สังเคราะห์ ก่อนฝังไอออน หลังฝังออกซิเจนไอออน และหลังอบที่ 800 °ซ เวลา 1 ชั่วโมง	52
4.3 เปรียบเทียบโดสที่ได้จากการวัดกระแสนะฝั่งไอออน โดสจาก Profile code และโดสจากการวัดเทคนิค RBS	74

สารบัญภาพ

รูป	หน้า	
2.1	โครงสร้างของคอร์รันดัม ภาพบนแสงเป็นโครงสร้างที่มองตรงตามแนวแกน c ภาพล่างแสดงทิศทางตั้งฉากกับแกน c รูปขวาแสดงรูป 3 มิติ	4
2.2	(a) และ (b) แสดง distorted octahedral ของลิแกนด์ออกซิเจนรอบอะลูมิเนียม ไอออน (c) ทรงเหลี่ยมแปดหน้าแบบสมมาตรปกติ	5
2.3	สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและช่วงความยาวคลื่นแสงที่ตามองเห็น	6
2.4	อันตรกิริยาของแสงเมื่อเคลื่อนที่ผ่านวัสดุโปร่งแสง	7
2.5	รูปร่างและทิศทางของ d-ออร์บิทัล	9
2.6	การเรียงลิแกนด์ทั้งหกรอบไอออนของโลหะเมื่อเกิดเป็น octahedral complex	10
2.7	ระดับพลังงาน 3d-ออร์บิทัล ของโลหะทรานซิชัน (a) ไอออนอิสระ (b) ไอออน ในสภาวะที่ถูกล้อมรอบด้วยประจุลบ (c) ไอออนของโลหะทรานซิชันที่อยู่ใน octahedral field ของแอนไอออน (d) การแยกพลังงานเนื่องจากสนามผลึก	11
2.8	(a) การเรียงตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมโครเมียม (b) การเรียงตัวของอิเล็กตรอน ในโครเมียมไอออน	12
2.9	ระดับพลังงานของโครเมียมเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมต่างกัน	13
2.10	(a) เครื่องแสดงลักษณะแกนแสงเดี่ยวชนิดบวก (b) เครื่องแสดงลักษณะแกนแสง เดี่ยวชนิดลบ	15
2.11	(a) ภาคตัดหลักแสดงผิวความเร็วของคลื่นแสงในทิศทางรังสีของผลึก แกนแสงเดี่ยวชนิดบวก (b) ภาคตัดหลักซึ่งแสดงผิวความเร็วของคลื่นแสง ในทิศทางรังสีของผลึกแกนแสงเดี่ยวชนิดลบ	16
2.12	อันตรกิริยาระหว่างไอออนกับวัสดุที่เป็นของแข็ง	17
2.13	ความเร็วของไอออนที่มีผลต่อ nuclear stopping แล electronic stopping	18
2.14	การชนแบบยืดหยุ่นของอะตอมที่เคลื่อนเข้าชนกับอะตอมของเป้า	19
2.15	อันตรกิริยาของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนระหว่างอะตอมของไอออนและอะตอมของเป้า	20
2.16	stopping power ของ Ge^+ ในซิลิกอนอสัณฐาน	20
2.17	total path length และ project range ของไอออนในวัสดุ	21
2.18	ความไร้ระเบียบของแลตทิซในวัสดุที่เป็นเป้า	22

2.19	(บน) โครงสร้างผลึกของซิลิกอนในทิศทาง <110>(ล่าง) ที่มุม 10 องศาจากทิศทาง <110>	23
2.20	(a) การแพร่แบบช่องว่างหรือแบบแทนที่ (b) การแพร่แบบแทรกที่	25
2.21	พลังงานก่อกัมมันต์ของการแพร่แบบแทนที่และแบบแทรกที่	25
2.22	การแพร่ของอะตอมเข้าสู่ภายในผิววัสดุ	27
3.1	แสดงลักษณะตัวอย่างก่อนการฝังไอออน (ก) ทับทิมสังเคราะห์ (ข) แซฟไฟร์สังเคราะห์ กำลังขยาย 16 เท่า	35
3.2	(a) แสดงแผนภาพของเครื่องวัดดัชนีเห (b) ภาพที่มองเห็นผ่านเลนส์ตา	35
3.3	แผนภาพแสดงการติดตั้งระบบของสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ สำหรับวัดการดูดกลืนแสง	37
3.4	UV-VIS-NIR spectrophotometer รุ่น U-4100 ของบริษัท Hitachi	38
3.5	แผนภาพระบบทางแสงของเครื่อง UV-VIS-NIR spectrophotometer รุ่น U-4100 ของบริษัท Hitachi	39
3.6	แผนภาพของแวนเรียนอิมพลานเตอร์ รุ่น 200-DF5	40
3.7	แผนภาพ faraday cup	42
3.8	ลักษณะ center faraday cup ของเครื่องแวนเรียนอิมพลานเตอร์	42
3.9	ลักษณะของ main faraday cup และ center faraday cup	43
3.10	Profile ของ Ar ⁺ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{15} ไอออน/ซม ²	43
3.11	Profile ของ Ar ⁺ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{16} ไอออน/ซม ²	44
3.12	Profile ของ Ar ⁺ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{16} ไอออน/ซม ²	44
3.13	Profile ของ Ar ⁺ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{17} ไอออน/ซม ²	45
3.14	Profile ของ Ar ⁺ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ²	45
3.15	Profile ของ O ⁺ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{15} ไอออน/ซม ²	46
3.16	Profile ของ O ⁺ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{16} ไอออน/ซม ²	46
3.17	Profile ของ O ⁺ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{17} ไอออน/ซม ²	47
3.18	Profile ของ O ⁺ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{17} ไอออน/ซม ²	47
3.19	Profile ของ O ⁺ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ²	48
3.20	ความสัมพันธ์ระหว่างโดสจากการคำนวณและโดสจากโปรแกรม Profile เมื่อฝัง Ar ⁺ พลังงาน 60 keV บน Al ₂ O ₃	48

3.21	ความสัมพันธ์ระหว่างโดสจากการคำนวณและโดสจากโปรแกรม Profile เมื่อฝัง O^+ พลังงาน 60 keV บน Al_2O_3	49
4.1	ลักษณะตัวอย่างหลังฝังไอออน (ก) ทับทิมสังเคราะห์ (ข) แซฟไฟร์สังเคราะห์	51
4.2	การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์ก่อนการฝังไอออน	53
4.3	การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์ ก่อนและหลังฝัง Ar^+ โดส 1×10^{16} ไอออน/ซม ² เวลา 9.30 นาที	54
4.4	การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์ ก่อนและหลังฝัง Ar^+ โดส 1×10^{17} ไอออน/ซม ² เวลา 1.38 ชั่วโมง	54
4.5	การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์ ก่อนและหลังฝัง Ar^+ โดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ² เวลา 5.26 ชั่วโมง	55
4.6	การดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์สังเคราะห์ก่อนการฝังไอออน	56
4.7	การดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์สังเคราะห์ก่อนและหลังฝัง Ar^+ โดส 1×10^{16} ไอออน/ซม ² เวลา 9.30 นาที	56
4.8	การดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์สังเคราะห์ก่อนและหลังฝัง Ar^+ โดส 1×10^{17} ไอออน/ซม ² เวลา 1.38 ชั่วโมง	57
4.9	การดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์สังเคราะห์ก่อนและหลังฝัง Ar^+ โดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ² เวลา 5.26 ชั่วโมง	57
4.10	การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์หลังฝัง Ar^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ที่โดสต่างๆ	58
4.11	การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์หลังฝัง Ar^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{15} ไอออน/ซม ² เวลา 30 นาที และหลังการอบที่ 800°C เวลา 1 ชั่วโมง	59
4.12	การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์หลังฝัง Ar^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{16} ไอออน/ซม ² เวลา 9.30 นาที และหลังการอบที่ 800°C เวลา 1 ชั่วโมง	59
4.13	การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์หลังฝัง Ar^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 5×10^{16} ไอออน/ซม ² เวลา 26 นาที และหลังการอบที่ 800°C เวลา 1 ชั่วโมง	60
4.14	การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์หลังฝัง Ar^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{17} ไอออน/ซม ² เวลา 1.38 ชั่วโมง และหลังการอบที่ 800°C เวลา 1 ชั่วโมง	60
4.15	การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์หลังฝัง Ar^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ โดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ² เวลา 5.26 ชั่วโมง และหลังการอบที่ 800°C เวลา 1 ชั่วโมง	61

4.30	การดูดกลืนแสงของทับทิมสังเคราะห์ที่ฝังด้วย O^+ หลังการอบที่ $800^{\circ}C$ เวลา 1 ชั่วโมง	69
4.31	การดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์สังเคราะห์หลังฝัง O^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ ที่โดสต่างๆ	70
4.32	การดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์สังเคราะห์หลังฝัง O^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ โดส 5×10^{15} ไอออน/ซม ² เวลา 5 นาที และหลังการอบที่ $800^{\circ}C$ เวลา 1 ชั่วโมง	71
4.33	การดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์สังเคราะห์หลังฝัง O^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ โดส 1×10^{16} ไอออน/ซม ² เวลา 18 นาที และหลังการอบที่ $800^{\circ}C$ เวลา 1 ชั่วโมง	71
4.34	การดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์สังเคราะห์หลังฝัง O^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ โดส 1×10^{17} ไอออน/ซม ² เวลา 1.43 ชั่วโมงและหลังการอบที่ $800^{\circ}C$ เวลา 1 ชั่วโมง	72
4.35	การดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์สังเคราะห์หลังฝัง O^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ โดส 5×10^{17} ไอออน/ซม ² เวลา 4.18 ชั่วโมง และหลังการอบที่ $800^{\circ}C$ เวลา 1 ชั่วโมง	72
4.36	การดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์สังเคราะห์หลังฝัง O^+ พลังงาน 60 กิโลอิเล็กตรอนโวลท์ โดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ² เวลา 11.09 ชั่วโมงและหลังการอบที่ $800^{\circ}C$ เวลา 1 ชั่วโมง	73
4.37	การดูดกลืนแสงของแซฟไฟร์สังเคราะห์ที่ฝังด้วย O^+ หลังการอบที่ $800^{\circ}C$ เวลา 1 ชั่วโมง	73
4.38	เปรียบเทียบโดสจาก Profile code และโดสบนทับทิมและแซฟไฟร์สังเคราะห์ จากการวัดด้วย RBS	75
4.39	ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากการฝัง Ar^+ บนทับทิมสังเคราะห์ โดส 1×10^{16} ไอออน/ซม ² (ก) กำลังขยาย 5000 เท่า (ข) กำลังขยาย 10000 เท่า	76
4.40	ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากการฝัง O^+ บนแซฟไฟร์สังเคราะห์ที่กำลังขยาย 2000 เท่า (ก) 1×10^{17} ไอออน/ซม ² (ข) 5×10^{17} ไอออน/ซม ²	77
4.41	ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากการฝัง Ar^+ บนแซฟไฟร์สังเคราะห์ โดส 1×10^{18} ไอออน/ซม ² (ก) กำลังขยาย 2500 เท่า (ข) กำลังขยาย 10000 เท่า	77
4.42	ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากการฝัง O^+ บนทับทิมสังเคราะห์ โดส 5×10^{17} ไอออน/ซม ² (ก) กำลังขยาย 3000 เท่า (ข) กำลังขยาย 6000 เท่า	78

- 4.43 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จากการฝัง O^+ บนทับทิมสังเคราะห์
 ที่โดส 1×10^{18} ไอออน/ซม² (ก) กำลังขยาย 2000 เท่า (ข) กำลังขยาย 10000 เท่า 78



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Copyright© by Chiang Mai University
 All rights reserved